(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2002年10月10日(10.10.2002)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 02/079799 A1

(51) 国際特許分類7: G01S 13/32, G01B 15/00, G01S 17/32, G01C 3/06, G01B 11/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP02/01825

(22) 国際出願日:

2002年2月27日(27.02.2002)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特顧2001-109270 2001年3月1日(01.03.2001) JP 特願2001-130355 2001年3月24日(24.03.2001)

特願2001-237280

2001年8月6日 (06.08.2001)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 積水樹脂 株式会社 (SEKISUI JUSHI CORPORATION) [JP/JP]; 〒530-0047 大阪府 大阪市 北区西天満2丁目4番4号 堂 島関電ビル6階 Osaka (JP).

(71) 出願人 および

(72) 発明者: 入谷 忠光 (IRITANI, Tadamitsu) [JP/JP]; 〒770-0874 徳島県 徳島市 南沖洲1丁目10番17号 Tokushima (JP).

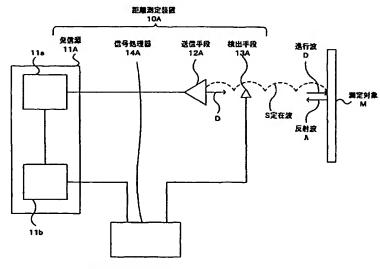
(74) 代理人: 山内 康伸 (YAMAUCHI, Yasunobu); 〒760-0023 香川県 高松市 寿町1丁目1番8号 日本生命高松 駅前ビル3階 Kagawa (JP).

- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM; ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特

[模葉有]

(54) Title: DISTANCE MEASURING DEVICE, DISTANCE MEASURING EQUIPMENT AND DISTANCE MEASURING METHOD

(54) 発明の名称: 距離測定装置、距離測定設備および距離測定方法



10A...DISTANCE MEASURING DEVICE

11A...SOURCE

14A...SIGNAL PROCESSOR

12A...TRANSMISSION MEANS

13A...DETECTION MEANS

S...STANDING WAVE

A...REFLECTION WAVE

D...PROGRESSIVE WAVE

M...OBJECT OF MEASUREMENT

(57) Abstract: A distance measuring device (10) for measuring a distance to an object (M) of measurement, comprising a source (11) for outputting variable-frequency signals, a transmission means (12) for emitting an electromagnetic wave having the same frequency as that of an output signal

計(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書

from the source (11), a detection means (13) provided between the transmission means (12) and the object (M), for detecting the amplitude of a standing wave (S) formed between the transmission means (12) and the object (M) and outputting a detection signal, and a signal processor (14) for producing a detection signal function indicative of a detection signal value relative to the output signal frequency to calculate, from its frequency, the distance between the detection means (13) and the object (M) of measurement.

(57) 要約:

本発明の距離測定装置は、測定対象Mまでの距離を測定するための測定装置10であって、測定装置10が、出力信号の周波数が可変である発信源11と、発信源11から出力された出力信号の周波数と同一の周波数を有する電磁波を放出する送信手段12と、送信手段12と測定対象Mとの間に設けられ、送信手段12と測定対象Mとの間に形成される定在波Sの振幅を検知し、検出信号を出力する検出手段13と、出力信号の周波数に対する検出信号の値を示す検出信号関数を形成し、その周期から検出手段13と測定対象Mとの間の距離を算出する信号処理器14とからなる。

明細書

距離測定装置、距離測定設備および距離測定方法

5 技術分野

10

25

本発明は、距離測定装置に関する。

アンテナや発光器から発信された電波や光等の波(進行波)は、その進行方向に測定対象があると、その測定対象で反射して進行波と逆向きに進む反射波となる。このため、アンテナ等から連続して電波等を出力すると、進行波と反射波が干渉して、アンテナと測定対象との間には定在波が形成される。本発明は上記のような定在波を用いて、測定対象までの距離を測定する距離測定装置、距離測定設備および距離測定方法に関する。

背景技術

15 電波を利用した距離決定装置としては、マイクロ波やミリ波を用いた電波レーダが一般によく知られている。電波レーダは方式によりパルスレーダ、FM CWレーダ等に分けられる。また、最近ではスペクトル拡散レーダあるいはC DMAレーダも見られる。

パルスレーダは、パルス信号を発信してからそれが測定対象で反射し戻って くるまでの時間を計測することにより測定対象までの距離を求めるものである。また、スペクトル拡散レーダやCDMAレーダも基本的にはパルスレーダ同様、測定対象までの往復の伝搬時間に基づき距離を測定するものである。

FMCWレーダは、周波数掃引した連続波を発信し発信信号と反射信号の周波数差から測定対象までの距離を求めるものである。この方式は測定対象の移動速度も同時に測定することができるという特徴がある。

しかるに、これらのレーダでは一般的に近距離の測定が難しく、最小探知距離は数10m以上であるという問題がある。

また、その他のレーダとしてはドップラレーダがあり、このドップラレーダは構造が簡単で近距離対象の測定も可能であるが、停止している測定対象まで

の距離を測定することはできないという問題がある。

さらに、従来のレーダでは、複数のレーダを近くで同時に使用した場合、受信器が他のレーダから発信された信号を受信することを避ける手段がなく、測定誤差が著しく増大したり、測定ができなくなるという問題がある。

5 一方、現在、車に対する障害物、特に歩行者との衝突を回避するために、障害物を検出し、その障害物と車の間の距離を測定する車載レーダが検討されている。この車載レーダは、最小探知距離が数10cm以下かつ相対的に停止している測定対象との間の距離の測定が必要であり、しかも他の車の車載レーダの発信信号の影響を受けることなく距離測定を行えなければならない。しかし、従来のレーダでは、この3つの条件を満たすことができない。したがって、上記の3つの条件を満たすレーダが求められている。

発明の開示

第1発明の距離測定装置は、測定対象までの距離を測定するための測定装置であって、該測定装置が、出力信号の周波数が可変である発信源と、該発信源に接続され、該発信源から出力された出力信号の周波数と同一の周波数を有する電磁波を、前記測定対象との間に存在する伝搬媒質に放出する送信手段と、該送信手段と前記測定対象との間に設けられ、該送信手段と前記測定対象との間において、前記伝搬媒質中に形成される定在波の振幅を検知し、検知した定在波の振幅に対応する検出信号を出力する検出手段と、該検出手段が発信した検出信号および前記発信源から発信された出力信号の周波数情報が入力され、前記出力信号の周波数に対する前記検出信号の値を示す検出信号関数を形成し、その周期から前記検出手段と前記測定対象との間の距離を算出する信号処理器とからなることを特徴とする。

25 第2発明の距離測定装置は、測定対象までの距離を測定するための測定装置であって、該測定装置が、出力信号の周波数が可変である発信源と、該発信源に接続され、該発信源から出力された出力信号の周波数と同一の周波数を有する電磁波を、前記測定対象との間に存在する伝搬媒質に放出する送信手段と、該送信手段と前記測定対象との間に設けられ、該送信手段と前記測定対象との

25

間において、前記伝搬媒質中に形成される定在波の振幅を検知し、検知した定在波の振幅に対応する検出信号を出力する検出手段と、該検出手段が発信した検出信号および前記発信源から発信された出力信号の周波数情報が入力され、前記出力信号の周波数に対する前記検出信号の値を示す検出信号関数を形成し、該検出信号関数が極大または極小となる少なくとも2以上の出力信号の周波数を検出し、該2以上の出力信号の周波数のうち2つの選択周波数と、該2つの選択周波数の間における極大または極小となる出力信号の周波数の数とから前記検出手段と前記測定対象との間の距離を算出する信号処理器とからなることを特徴とする。

10 第3発明の距離測定装置は、第2発明において、前記発信源から出力される 出力信号を周波数変調させるための変調器が設けられており、前記検出手段が 、前記定在波の振幅を検出し、その振幅に対応した振幅を有する検知信号を出 力する受信部と、前記変調器から変調信号が入力され、該変調信号によって前 記検知信号を同期検波して検波信号を形成し、該検波信号の振幅に対応する検 出信号を出力する検波部とを備えたことを特徴とする。

第4発明の距離測定装置は、測定対象までの距離を測定するための測定装置であって、該測定装置が、周期的に発光強度が変化する光を発信し、その周波数が可変である発光源と、該発光源から発信された光を2つに分光し、分光された一方の光を前記測定対象との間に存在する伝搬媒質に放出する分光手段と、前記測定対象で反射した一方の光と、分光された他方の光を干渉させて定在波を形成する定在波形成手段と、該定在波形成手段によって形成された定在波の振幅を検知し、検知した定在波の振幅に対応する検出信号を出力する検出手段と、該検出手段が発信した検出信号および前記発光源から発信された光の発光強度変化の周波数情報が入力され、該光の発光強度変化の周波数に対する検出信号の値を示す検出信号関数を形成し、その周期から前記検出手段と前記測定対象との間の距離を算出する信号処理器とからなることを特徴とする。

第5発明の距離測定装置は、測定対象までの距離を測定するための測定装置であって、該測定装置が、周期的に発光強度が変化する光を発信し、その周波数が可変である発光源と、該発光源から発信された光を2つに分光し、分光さ

れた一方の光を前記測定対象との間に存在する伝搬媒質に放出する分光手段と、前記測定対象で反射した一方の光と、分光された他方の光を干渉させて定在波を形成する定在波形成手段と、該定在波形成手段によって形成された定在波の振幅を検知し、検知した定在波の振幅に対応する検出信号を出力する検出手段と、該検出手段が発信した検出信号および前記発光源から発信された光の発光強度変化の周波数情報が入力され、該光の発光強度変化の周波数に対する検出信号の値を示す検出信号関数を形成し、該検出信号関数が極大または極小となる少なくとも2以上の発光強度変化の周波数を検出し、該2以上の発光強度変化の周波数のうち2つの選択周波数と、該2つの選択周波数の間における極大または極小となる出力信号の周波数の数とから前記検出手段と前記測定対象との間の距離を算出する信号処理器とからなることを特徴とする。

10

20

25

第6発明の距離測定装置は、第5発明において、前記発光源が発信する光の 発光強度変化を周波数変調させるための変調器が設けられており、前記検出手 段が、前記定在波の振幅を検出し、その振幅に対応した振幅を有する検知信号 を出力する受信部と、前記変調器から変調信号が入力され、該変調信号によっ て前記検知信号を同期検波して検波信号を形成し、該検波信号の振幅に対応す る検出信号を出力する検波部とを備えたことを特徴とする。

第7発明の距離測定設備は、測定対象の空間座標を検出することができる測定設備であって、該測定設備が、複数の第1発明、第2発明、第3発明、第4発明、第5発明または第6発明の距離測定装置と、該複数の距離測定装置を、同期して作動させる制御装置とからなり、各距離測定装置の信号処理器が算出した検出手段と前記測定対象との間の距離が入力され、入力された各測定装置における検出手段と前記測定対象との間の距離と、各距離測定装置の検出手段同士の相対的な位置とから測定対象の空間座標を算出する演算装置とからなることを特徴とする。

第8発明の距離測定方法は、測定対象までの距離を測定するための測定方法であって、送信手段によって、送信手段と測定対象の間に存在する伝搬媒質に電磁波を放出して、前記送信手段と測定対象との間において、伝搬媒質中に定在波を形成させ、前記送信手段と前記測定対象の間における一定の位置において、検出手段によ

って、前記定在波の振幅を検出し、前記送信手段が放出する電磁波の周波数を変化させて、該周波数に対する前記定在波の振幅を示す振幅曲線を形成し、該振幅曲線 の周期から、前記検出手段と前記測定対象との間の距離を算出することを特徴とする。

5

10

図面の簡単な説明・

- 図1は 第一実施形態の距離測定装置 10A の概略プロック図である。
- 図 2 は(A)は検出信号関数A(f, d_1)を示した図であり、(B)および(C)は、検出信号関数A(f, d_1)をフーリエ変換した変換関数F(c_y)を示した図である。
- 図3は距離測定装置10Aによって測定対象Mまでの距離を測定する作業のフローチャートである。
- 図4は距離測定装置10Aによって測定対象Mまでの距離を測定する作業のフローチャートである。
- 15 図5は第二実施形態の距離測定装置10Bの概略プロック図である。 図6は(A)は、出力信号の周波数と、受信部13Bの位置における定在波Sの振幅SPの関係を示した図であり、(B)は検波部13bが出力した検出信号と発信部11aが出力した信号の周波数fから形成される検出信号関数A(f,d₁)を示した図である。
- 20 図7は距離測定装置 10B によって測定対象Mまでの距離を測定する作業のフローチャートである。
 - 図8は定在波Sの形成を説明する概略説明図である。
 - 図9は伝送線路Lに沿った距離を測定する距離測定装置10Cの概略説明図である。
- 25 図10は第三実施形態の距離測定装置 10D のブロック図である。
 - 図11は本実施形態の距離測定設備1のプロック図である。
 - 図12は(A) は本実施形態の距離測定設備1による位置測定方法の概略説明図であり、(B) は位置を算出するために使用される式である。

発明を実施するための最良の形態

つぎに、本発明の実施形態を図面に基づき説明する。

図1は、第一実施形態の距離測定装置10Aの概略プロック図である。

同図に示すように、第一実施形態の距離測定装置 10A は、発信源11、送信手段12、検出手段13および信号処理器14から基本構成されており、送信手段12と測定対象Mとの間に形成される定在波Sを用いて、測定対象Mまでの距離を測定するようにしたことが特徴である。

まず、第一実施形態の距離測定装置 10A を説明する前に、定在波Sについて 説明する。

10 図8は定在波Sの形成を説明する概略説明図である。同図に示すように、電磁波発生器B1から周波数fの電磁波を空気等の伝搬媒質中に放出すると、電磁波は、進行波Dとなって伝搬媒質中を進行する。この進行波Dにおいて、電磁波発生器B1から距離xの位置における振幅VDは、その周波数fとxの関数として、以下の式で表される。

15 VD (f, x) = exp (j $2\pi f/c \cdot x$)

なお、符号cは光速を示している。

やがて、進行波Dが測定対象Mに到達すると、進行波Dが測定対象Mで反射して反射波Rとなり、この反射波Rは測定対象Mから電磁波発生器B1に向かって進行する。この反射波Rにおいて、電磁波発生器B1から距離xの位置における振幅VRは、進行波Dの周波数fと電磁波発生器B1からの距離xの関数として、以下の式で表される。

VR $(f, x) = MR \cdot e \times p \left(\int 2\pi f/c \cdot (2d-x) \right)$

 $(MR = \gamma \cdot exp(j\phi))$

20

なお、符号MRは、測定対象Mにおける電磁波の反射係数を示している。

25 そして、図8(B)に示すように進行被Dと反射波Rが干渉すると、電磁波 発生器B1と測定対象Mとの間に定在波Sが形成される。この定在波Sの振幅 SPを、電磁発生器B1からx1だけ測定対象Mに近い検出器B2で測定すると 、検出器B2が検出する定在波Sの振幅SPは、進行波Dの周波数fの関数と して以下の式で示される。

Sp $(f, x_1) = (1 + \gamma^2 + 2 \gamma \cos (2 \pi f/c \cdot 2 d_1 + \phi))^{1/2}$ $(d_1 = d - x_1)$

上記のように、検出器B2が設けられた位置における定在波Sの振幅SPは、電磁波発生器B1から発生される進行波Dの周波数fに対して周期的であって、その周期がc/2d₁となる。つまり、定在波Sの振幅SPは、検出器B2から測定対象Mまでの距離d₁に反比例する。したがって、進行波Dの周波数fを変化させれば、検出器B2が設けられた位置において、進行波Dの周期fに対する定在波Sの振幅SPの変動周期を求めることができるので、定在波Sによって測定対象Mまでの距離を測定できるのである。

10 さて、第一実施形態の距離測定装置 10A について説明する。

図1に示すように、発信源 11A は、発信部 11a と周波数制御部 11b とから構成されており、発信部 11a は、例えば交流電源等、一定の周波数 f の信号を出力できるものである。周波数制御部 11b は、発信部 11a が出力する信号の周波数 f を制御するためのものである。また、周波数制御部 11b は、発信部 11a の発信の発信した周波数 f に関する情報、例えば、発信部 11a が発信した信号の周波数 f の数値や発信部 11a が発信する信号と同じ周波数 f を有する信号等を出力することができるものである。

前記発信源 11A には、例えばアンテナや増幅器等の送信手段 12A が接続されている。この送信手段 12A は、送信手段 12A と測定対象Mとの間に存在する、

20 例えば空気や水等の伝搬媒質中もしくは真空中に、発信源 11A の発信部 11a が 発信した信号と同じ周波数 f を有する電磁波を放出するものである。

このため、発信源 11A の周波数制御部 11b によって発信部 11a が発信する信号の周波数 f を変えれば、送信手段 12A から放出される電磁波の周波数を変えることができる。

25 前記送信手段 12A と測定対象Mとの間には、アンテナや振幅検出器、自乗検 波器等の検出手段 13A が設けられている。この検出手段 13A は、送信手段 12 A から放出された電磁波(以下、進行波Dという)と、測定対象Mにおいて、 反射した反射波とが干渉して形成される定在波Sの振幅SPを検知するための ものであり、測定対象Mから距離d,の位置に設けられている。この検出手段 1

3A.は、定在波Sの振幅SPに対応する検出信号、例えば、定在波Sの振幅SPと同じ、もしくは振幅SPの自乗に比例した電流や電圧等を出力することができるものである。

前記検出手段 13A には、信号処理器 14A が接続されている。この信号処理器 14A は、例えばデジタルシグナルプロセッサ (DSP) やメモリ等であり、入力されたデータを記録する記録部と、この記録部に記録されたデータを演算する演算部を備えており、この演算部によって検出手段 13A から測定対象Mまでの距離 d,を算出することができるものである。

また、信号処理器 14A は、前記発信源 11A の周波数制御部 11b にも接続されており、発信源 11A の周波数制御部 11b から発信部 11a の発信した出力信号の周波数 f に関する情報(以下、単に出力信号の周波数情報という)を受けるとともに、検出手段 13A から検出信号を受信したときに、発信源 11A の周波数制御部 11b に受信確認信号を送ることができる。

なお、第一実施形態の距離測定装置 10A では、送信手段 12A と検出手段 13 A を別々に設けているが、1つのアンテナによって送信手段 12A と検出手段 13 A とを兼用させてもよい。この場合、装置をコンパクトかつ簡単な構造のものとすることができる。

つぎに、第一実施形態の距離測定装置 10A の作用と効果を説明する。

図2 (A) は検出信号関数A (f, d_1)を示した図であり、(B) および (C) は、検出信号関数A (f, d_1)をフーリエ変換した変換関数F (cy)を示した図である。図 3 は、距離測定装置 10A によって測定対象Mまでの距離を測定する作業のフローチャートである。

図 $1\sim$ 図3に示すように、まず、発信源 11A の周波数制御部 11b によって、発信部 11a が発信する信号の初期周波数 f および最終周波数 f な設定する。

25 そして、周波数制御部 11b によって発信部 11a から周波数 f が初期周波数 f L である信号を発信させれば、その信号を受けた送信手段 12A から、周波数 f が 初期周波数 f L である進行波Dが、測定対象Mに向けて、伝搬媒質中に放出される。このとき、出力信号の周波数情報が周波数制御部 11b から信号処理器 14A に送信される。

20

25

送信手段 12A から放出された進行波Dは伝搬媒質中を伝播して、測定対象M に到達し、この測定対象Mで反射して反射波となり、進行波Dと逆向き、つまり送信手段 12A に向かって伝搬媒質中を伝播する。すると、進行波Dと反射波が干渉して、送信手段 12A と測定対象Mの間における伝搬媒質中に、定在波S が形成される。

この定在波Sの振幅SPは、送信手段 12A と測定対象Mの間に設けられた検 出手段 13A によって検知され、検出手段 13A が定在波Sの振幅SPに対応する 検出信号を信号処理器 14A に送信する。

検出手段 13A からの検出信号を受けた信号処理器 14A は、記録手段によって 検出信号の値Pを周波数制御部 11b から送信された出力信号の周波数情報と1 対1に対応させて、記録する。同時に、周波数制御部 11b に受信確認信号を送 信する。

信号処理器 14A からの受信確認信号を受けた周波数制御部 11b は、発信部 1 1a が発信する信号の周波数 f をステップ周波数 Δ f だけ変化させる。すると、送信手段 12A から放出される進行波Dの周波数 f が f $_{L}$ + Δ f に変化するが、進行波Dは一定の速度(光速)で伝播するため、進行波Dの波長が変化することになる。

したがって、送信手段 12A と測定対象Mとの間における伝搬媒質中に形成される定在波Sが変化し、検出手段 13A が検知する定在波Sの振幅SPが変化するので、検出手段 13A から信号処理器 14A に送られる検出信号の値Pが変化する。この検出信号の値Pは、信号処理器 14A の記録手段によって、発信部 11a の出力信号の周波数情報と1対1に対応させて、記録される。

そして、再び信号処理器 14A からの受信確認信号を受けると、周波数制御部 11b は、発信部 11a が発信する信号の周波数 f をステップ周波数 Δf 分だけ変化させる

上記の処理を、発信部 11a が発信する信号の周波数 f が最終周波数 f_u と一致するまでくり返し、発信部 11a が出力する出力信号の周波数 f が最終周波数 f_u と一致すると、発信部 11a の発信が停止される。

ついで、信号処理器 14A の演算手段によって、記録手段に記録されている出

20

25

力信号の周波数情報と検出信号の値Pをから、検出信号関数A(f, d_1)が形成される。そして、信号処理器 14A の演算手段が、検出信号関数A(f, d_1)をフーリエ変換することによって、変換関数F(c y)が形成される。この変換関数F(c y)は、検出信号関数A(f, d_1)の周期 c yの位置にピークを有する関数となるので、信号処理機 14A によって変換関数F(c y)から検出信号関数A(f, d_1)の周期 c yを算出することができる。

前述したように、検出信号関数A(f, d_1)の周期 c y、つまり定在波Sの振幅SPの周期は検出手段 13A から測定対象Mまでの距離 d_1 に対して反比例するので、その周期より検出手段 13A から測定対象Mまでの距離 d_1 を算出することができる。

したがって、距離測定装置 10A は、検出手段 13A から測定対象Mまでの距離 d_1 を測定することができる。

また、検出手段 13A から測定対象Mまでの距離 d_1 は、出力信号の周波数 fに対する定在波Sの振幅SPの周期にのみ依存し、送信手段 12A によって進行波Dを発信してから測定対象Mに反射して検出手段 13A に戻るまでの時間の影響を受けないので、測定対象Mまでの距離 d_1 が数 1 0 センチ以下の近距離であっても、精度よく測定できる。

さらに、複数の測定対象Mの間に、複数の定在波Sが形成された場合、検出手段 13A が発信する検出信号は、複数の定在波Sの振幅SPが合成された値に対応するものとなる。すると、信号処理器 14A の演算手段が形成する検出信号関数A (f, d₁) は、検出手段 13A の位置における複数の定在波Sの振幅SPの変動を示す関数が合成された合成関数となるが、検出信号関数A (f, d₁)をフーリエ変換することによって形成される変換関数F (c y) は、各定在波Sの周期においてそれぞれ極大値を有する関数となる(図2(C)参考)。

したがって、複数の定在波Sの振幅SPの変動周期をそれぞれ求めることができるので、複数の測定対象Mと検出手段 13A との間の距離xを、それぞれ測定することができる。

 波数 f_L と最終周波数 f_U 間で出力信号の周波数 f をランダムに変化させて、各周波数 f における定在波 G の振幅 G を測定してもよい。この場合であっても、出力信号の周波数 G と定在波 G の振幅 G を対応させることができるので、信号処理器 G の演算手段によって検出信号関数 G (G) を形成することができる。

この場合、次のような効果が得られる。例えば、M系列符号等に従い出力信号の周波数 f をランダムに変化させれば、距離測定装置 10A 同士が、同じタイミングで、同位相かつ同じ周波数 f の電磁波を発信する確率はほとんどなくなる。

10 そして、定在波Sの振幅SPは同一周波数の成分によって生じるものである ため、たとえ検出手段 13A が他の距離測定装置が発信した電磁波を受信しても 、その信号成分は低域通過フィルタ等により容易に除去可能である。

よって、他の距離測定装置から発信された電磁波によって測定誤差が著しく増大したり、測定不能となることを防ぐことができる。

また、信号処理器 14A の演算手段によって、検出信号関数 A (f, d_1) の周期を求める代わりに、検出信号関数 A (f, d_1) が極大極小となる出力信号の周期数 f を 2 以上求めて、それらの周波数 f から測定対象 M と送信手段 12A との間の距離 x を求めてもよい。

図4に示すように、信号処理器 14A によって検出信号関数A (f, d_1) を形 20 成した後、信号処理器 14A によって検出信号関数A (f, d_1) が極小または極大となる 2 以上の周波数 f $n \sim f$ n + k を検出する。

ついで、この2以上の周波数 f $n \sim f$ n + k のうち、2つの選択周波数 f n , f n + k を選択する。そして、この2つの選択周波数 f n , f n + k の間に形成される極小または極大となる周波数の数 k - 1 を算出する。

25 すると、検出手段 13A と測定対象Mとの間の距離 d_1 は、以下の式によって求められる。

 $d_1 = k \cdot c / (4 \cdot (f_{NK} - f_N))$

20

25

によって、検出手段13Aから測定対象Mまでの距離を測定することかできる。 つぎに、第二実施形態の距離測定装置 10B を説明する。

図5は第二実施形態の距離測定装置 10B の概略プロック図である。同図に示すように、第二実施形態の距離測定装置 10B は、発信源 11B、送信手段 12B、

6 検出手段 13B および信号処理器 14B に加えて、変調器 20 を設け、信号処理器 14B が検出信号関数 $A(f, d_1)$ の極大または極小となる発信部 11a の出力信号の周波数 f を検出する精度を高くしたことが特徴である。

図5に示すように、発信源 11B において、発信部 11a と周波数制御部 11b との間には、変調器 20 が設けられている。この変調器 20は、周波数制御部 11b が発信部 11a から出力させる周波数 f を設定した場合、発信部 11a からはこの周波数 f を中心周波数として周期的に変動する信号を出力させるためのものである。つまり、発信部 11a の出力信号に周波数変調を加えるためのものである。

また、この変調器20は、検出手段13Bに、変調信号を出力することができる。この変調信号とは、周波数変調された発信部11aの出力信号において、周波数制御部11bが設定した周波数fに対して周期的に変動する変動成分の信号である。

前記検出手段13には、受信部13aと検波部13bが設けられている。

受信部 13a は、定在波Sの振幅SPを検出し、その振幅SPに対応した振幅 を有する検知信号を出力するものである。

この受信部 13a には、検波部 13b が接続されている。この検波部 13b は、前記変調器 2 0 からの変調信号および受信部 13a からの検知信号を記録する記録部と、この記録部に記録された検知信号を変調信号を用いて同期検波して検波信号を形成し、この検波信号の振幅に対応する検出信号を出力する演算する演算部を備えている。

また、検波部 13b は、前記受信部 13a からの検知信号を受けると、変調器 2 0 に受信確認信号を送ることができる。

なお、第一実施形態の距離測定装置 10A と同様に、第二実施形態の距離測定 装置 10B においても、送信手段 12B と検出手段 13B を別々に設けているが、

25

WO 02/079799 PCT/JP02/01825

13

1つのアンテナによって送信手段 12B と検出手段 13B とを兼用させてもよい。 この場合、装置をコンパクトかつ簡単な構造のものとすることができる。

つぎに、第二実施形態の距離測定装置 10B の作用と効果を説明する。

なお、周波数変調を行う作業以外は、第一実施形態の距離測定装置 10A において、信号処理器 14 が検出信号関数 A (f, d_1) の極大極小を求める場合と同じであるので、以下には周波数変調を行う作業のみを説明する。

図 6 (A) は、出力信号の周波数と、受信部 13B の位置における定在波 S の 振幅 S P の関係を示した図であり、(B) は検波部 13b が出力した検出信号と 発信部 11a が出力した信号の周波数 f から形成される検出信号関数 A (f, d₁)を示した図である。図 7 は距離測定装置 10B によって測定対象 Mまでの距離 を測定する作業のフローチャートである。

図5~図7に示すように、まず、周波数制御部11bが設定した周波数が周波数 f である場合、変調器 2 0 によって周波数変調が加えられ、発信部11aからは、周波数 f が f + f d $\cos \theta$ ($\theta = 0$) である信号が発信され、その信号を受けた 送信手段12Bから、周波数 f が初期周波数 f + f d $\cos \theta$ ($\theta = 0$) である進行 波Dが、測定対象Mに向けて、伝搬媒質中に放出される。このとき、出力信号の 周波数変調情報が変調器 2 0 から検出手段13Bの検波部13bに送信される。

すると、送信手段12Bと測定対象Mの間に定在波Sが形成され、検出手段13Bの受信部13aが、その位置における定在波Sの振幅SPを検知して、この定在波Sの振幅SPに対応する検知信号を検波部13bに送信する。

受信部 13a からの検知信号を受けた検波部 13b は、その値を変調器 2 0 から 送信された出力信号の周波数変調情報と 1 対 1 に対応させて、記録する。同時 に、変調器 2 0 に受信確認信号を送信する。

検出手段 13B の検波部 13b からの受信確認信号を受けた変調器 2 0 は、発信部 11a が発信する信号の周波数 f を f + f d cos θ (θ = θ + d θ) に変化させる。すると、送信手段 1 2 から放出される進行波 D の周波数 f が f + f d cos θ (θ = θ + d θ) に変化するので、検出手段 13B の受信部 13a が検知する定在波 S の振幅 S P が変化するので、検出手段 13B の受信部 13a から検波部 13b に送られる検知信号の値が変化する。この検知信号は、検波部 13b の記録手段に

25

よって、発信部 11a の出力信号の周波数変調情報と1対1に対応させて、記録手段によって記録される。

そして、再び検出手段 13B の検波部 13b からの受信確認信号を受けると、変調器 20は、発信部 11a が発信する信号の周波数 f を f + f d $\cos\theta$ ($\theta = \theta$ + 2 d θ) に変化させる。

上記の処理を、発信 $\theta = 2\pi$ となるまでくり返す。

そして、θ=2πとなると、検波部 13b の演算手段が、記録された検知信号を周波数変調情報を用いて検知信号を同期検波して検波信号を形成する。そして、検波部 13b はこの検波信号の振幅に対応する検出信号を信号処理器 14B に出力するので、この検出信号は、発信源 11B の周波数制御部 11b から信号処理器 14B に送られた周波数情報と 1 対 1 に対応させて、信号処理器 14B の記録手段に記録される。

そして、周波数制御部 11b が発信部 11a に発信させる周波数を初期周波数 f_L から最終周波数 f_U まで変化させれば、信号処理器 14B によって、検出信号周期A(f、d,)が形成される。

図6(B)に示すように、この検知信号関数は、定在波Sの振幅SPが極小または極大となる周波数近傍では単調増加又は単調減少、しかも、定在波Sの振幅SPが極小または極大となる周波数の前後で、検出信号曲線A(f, d₁)の検知信号の値Pの符号が変化する曲線となる。

20 したがって、第二実施形態の距離測定装置 10B によれば、定在波Sの振幅S Pが極小または極大となる周波数 f の検出が正確になり、測定誤差を小さくすることができる。

また、前述の距離測定装置10による距離測定方法を応用すれば、ロボットや NCマシン等の産業機械において、作業を行う装置までの距離を測定することも 可能である。

図9において、符号Lは、作業を行う装置などに信号を送信する、例えばマイクロスプリットライン等の複数本の電線が平行に設けられた伝送線路を示している。この伝送線路Lの近傍には、作業を行う装置等の測定対象M1,M2に金属片等を設けておき、この金が配設されている。この測定対象M1,M2に金属片等を設けておき、この金

属片等を伝送線路Lに近づけておく。そして、伝送線路Lに、信号源抵抗RS を通して、発信源 11C となる交流電源から交流電流を供給する。

すると、金属片が近づけられた位置、つまり測定対象M1,M2の位置では、 交流電流が形成する電場が乱れるので、測定対象M1,M2の位置と信号源抵抗 RSとの間には定在波Sが形成される。このため、発信源 11C となる交流電源 の周波数を変化させて、自乗検波器等の検出手段 13C によって交流電流の電力 を検知すれば、信号処理機 14C によって検出手段 13C から測定対象M1,M 2までの伝送線路Lに沿った長さを測定することができる。

しかも、定在波Sは、曲がった伝送線路Lに沿って形成されるため、伝送線 10 路Lが曲がっていても、信号源抵抗RSから測定対象M1,M2までの伝送線 路Lに沿った長さを正確に求めることができる。

さらに、伝送線路Lの終端抵抗 Rt を不整合状態にして、伝送線路Lの終端と信号源抵抗RSとの間に定在波Sを形成すれば、伝送線路Lの全長も定在波Sによって計測すれることができる。したがって、伝送線路Lの全長がわかっていれば、定在波Sによって計測された伝送線路Lの全長と、実際の伝送線路Lの全長によって、検出手段 13C から測定対象M1,M2までの伝送線路Lに沿った長さを補正することができるので、測定結果が正確になる。

つぎに、第三実施形態の距離測定装置 10D を説明する。

図10は第三実施形態の距離測定装置 10D のプロック図である。同図に示す 20 ように、発信源 11D、分光手段 31、反射用ミラー32、検出手段 13D および信号処理器 14D から基本構成されており、第一、第二実施形態の距離測定装置 10A,10B と異なり、発信源 11D が発信する光の強度を周期的に変化させて、分光手段 31 と検出手段 13D の間に形成される定在波 S によって、測定対象Mまでの距離を測定するようにしたことが特徴である。

25 なお、検出手段 13D によって検知された検出信号から、検出手段 13D と測定対象Mまでの距離を算出する方法は、前述の第一実施形態の距離測定装置 10 A と同様であるので、以下には第三実施形態の距離測定装置 10D の構成のみを説明する。

図10に示すように、発信源 11D は、発信部 11a と周波数制御部 11b とから

15

20

25

構成されており、発信部 11a は、例えばレーザや発光ダイオード等、発信する 光の発光強度を、その強度変化が一定の周波数 f となるように出力することが できるものである。周波数制御部 11b は、発信部 11a が出力する光の発光強度 変化の周波数 f を制御するためのものである。また、周波数制御部 11b は、発 信部 11a の発信の発信した光の発光強度変化の周波数 f に関する情報、例えば 、発信部 11a が発信した光の発光強度変化の周波数 f の数値や発信部 11a が発 信する光の発光強度変化の周波数 f を有する信号等を出力する ことができるものである。

発信源 11D の発信部 11a と測定対象Mの間には、例えばビームススプリッタ等の分光手段 3 1 が設けられている。この分光手段 3 1 は、発信源 11D の発信部 11a から発信された光を 2 つに分光し、分光された一方の光を測定対象Mとの間に存在する伝搬媒質中に放出するものである。分光された他方の光は、後述する反射用ミラー 3 2 に供給される。

また、分光手段31は、測定対象Mで反射して戻ってきた反射光を、後述する検出手段13Dに向けて反射することができる。

前記分光手段31の側方には、反射用ミラーが設けられている。この反射用ミラー32は、前記分光手段31によって分光された他方の光の光を再び分光手段31に向けて反射するものである。この反射用ミラー32によって反射された光は、分光手段31を透過し、後述する検出手段13Dに向けて進行する。

このため、分光手段31と後述する検出手段13Dとの間において、測定対象Mで反射して戻ってきた反射光と反射用ミラー32によって反射された光とが干渉し、分光手段31と後述する検出手段13Dとの間に定在波Sが形成されるのである。

前記分光手段31の側方において、分光手段31を挟んで前記反射用ミラーと線対称の位置には検出手段13Dが設けられている。この検出手段13Dは、測定対象Mで反射して戻ってきた反射光と反射用ミラー32によって反射された光とが干渉して形成される定在波Sの振幅SPを検知するためのものである。この検出手段13Dは、定在波Sの振幅SPに対応する検出信号、例えば、定在波Sの振幅SPの発光強度を検知して発光強度を電圧に変換して検知信号を

20

出力するフォトディデクターを備えており、このフォトディデクターから出力される検知信号は、定在被Sの振幅SPと同じもしくは振幅SPの自乗に比例した電流や電圧等を出力することができるものである。

前記検出手段 13D には、信号処理器 14D が接続されている。この信号処理器 14D は、例えばデジタルシグナルプロセッサ (DSP) やメモリ等であり、入力されたデータを記録する記録部と、この記録部に記録されたデータを演算する演算部を備えており、この演算部によって分光手段31から測定対象Mまでの距離dを算出することができるものである。

また、信号処理器14Dは、前記発信源11Dの周波数制御部11bにも接続されており、発信源11Dの周波数制御部11bから発信部11aの発信した出力信号の周波数 f に関する情報(以下、単に出力信号の周波数情報という)を受けるとともに、検出手段13Dから検出信号を受信したときに、発信源11Dの周波数制御部11bに受信確認信号を送ることができる。

したがって、第三実施形態の距離測定装置 10D によれば、第一実施形態の距離測定装置 10D と同様に、分光手段 3 1 から測定対象Mまでの距離 d を測定することができる。

また、測定対象Mまでの距離xが数10センチ以下の近距離であっても、精度よく測定できる。

さらに、発信部 11a が出力する出力信号の周波数 f を、初期周波数 f_{r} と最終周波数 f_{v} 間でランダムに変化させれば、他の距離測定装置から発信された光によって測定誤差が著しく増大したり、測定不能となることを防ぐことができる

さらに、複数の定在波Sの振幅SPの変動周期をそれぞれ求めることができるので、複数の測定対象Mと分光手段31との間の距離dを、それぞれ測定することができる。

なお、信号処理器14Dの演算手段によって、検出信号関数A(f, d_1)が極大極 小となる出力信号の周期数 f を 2 以上求めて、それらの周波数 f_L から測定対象Mと 分光手段 3 1 との間の距離 d を求める場合、初期周波数 f_L を 0 Hz として、任意の 最終周波数 f_U まで出力信号の周期数 f を変化させてもよい。この場合、検出信号関

20

数A(f, d_1)において、出力信号の周期数 f が 0 の場合には必ず検出信号関数 A (f, d_1)は極大となる。したがって、初期周波数 f_L から最終周波数 f_U の間において、検出信号関数 A (f, d_1)が極大となる出力信号の周期数 f を 1 つだけ求めるだけで、その周波数 f と初期周波数 f_L とを用いて、測定対象Mと分光手段 3 1 との間の距離 d を求めることができる。

さらになお、第二実施形態の距離測定装置 10B と同様に、発信する発光強度 に周波数変調を加える変調器を設ければ、定在波の振幅が極小または極大とな る周波数の検出が正確になり、測定誤差を小さくすることができる。

つぎに、本実施形態の距離測定設備1を説明する。

10 図11は本実施形態の距離測定設備1のプロック図である。同図に示すように 、本実施形態の距離測定設備1は、複数の前記距離測定装置10を備えている。 この複数の距離測定装置10には、制御装置3が接続されている。この制御装置 3は、前記複数の距離測定装置10を同期して作動させるためのものであり、各 距離測定装置10から、電磁波を伝搬媒質中に同時に放出させることができる。

また、複数の距離測定装置10には、演算装置2が接続されている。この演算装置2には、各距離測定装置10の信号処理器14が算出した検出手段13と測定対象Mとの間の距離xが入力されるものであり、この入力された各測定装置10における検出手段13と測定対象Mとの間の距離および各距離測定装置10の検出手段13同士の相対的な位置とから測定対象Mの空間座標を算出することができる。

つぎに、本実施形態の距離測定設備1の作用と効果を説明する。

図12(A) は本実施形態の距離測定設備1による位置測定方法の概略説明図であり、図12(B) は位置を算出するために使用される式である。同図に示すように、制御装置3によって、2つの距離測定装置10を同期し、同時に電磁波を発信させる。すると、各距離測定装置10と測定対象Mとの間に定在波S1,S2が形成され、各距離測定装置10から測定対象Mまでの距離d1,d2が算出される。

この各距離測定装置10から測定対象Mまでの距離d1,d2が、演算装置2に入力される。図12(A) に示すように、各距離測定装置10同士の距離は

 ${\bf r}$ であるから、両者の中間位置から測定対象までの距離 ${\bf d}$ が算出され、両者の二等分線と、前記中間位置と測定対象 ${\bf M}$ を結ぶ線分とのなす角度 ${\bf \theta}$ が算出される。

したがって、各距離測定装置10の中間位置から測定対象までの距離dと、 前記中間位置と測定対象Mを結ぶ線分とのなす角度θを用いれば、各距離測定 装置10と前記測定対象Mが存在する平面における、各距離測定装置10と前 記測定対象Mの相対的な位置を把握することができる。

なお、各距離測定装置10を3つ設ければ、各距離測定装置10と測定対象Mとの相対的な位置関係を3次元的に把握することができる。

10

15

20

産業上の利用可能性

第1発明によれば、以下の(1)~(4)に示す効果が得られる。

- (1) 発信源から出力された出力信号の周波数を変化させれば、送信手段から放出される電磁波の波長が変化するので、送信手段と測定対象との間の伝搬媒質中に形成される定在波が変化し、検出手段が設けられた位置における定在波の振幅が変化する。このため、出力信号の周波数を変化させれば検出手段が出力する検出信号の値が変化するので、出力信号の周波数情報と検出信号の値から、信号処理器によって検出信号関数を形成させることができる。検出手段が設けられた位置における定在波の振幅は、電磁波の周波数、つまり発信源から出力された出力信号の周波数に対して周期的に変化し、その周期は検出手段から測定対象までの距離に対して反比例する。したがって、定在波の振幅の周期、つまり検出信号関数の周期が求められるから、その周期より検出手段から測定対象までの距離を算出することができ、検出手段から測定対象までの距離を算出することができる。
- 25 (2) 検出手段から測定対象までの距離は、出力信号の周波数に対する定在波の振幅の変動周期にのみ依存し、送信手段によって電磁波を発信してから測定対象に反射して検出手段に戻るまでの時間の影響を受けないので、測定対象までの距離が数10センチ以下の近距離であっても、精度よく測定できる。
 - (3) 検出信号関数を形成させるときに、出力信号の周波数をランダムに変化させ

た場合、例えば、M系列符号等に従い出力信号の周波数をランダムに変化させれば、距離測定装置同士が、同じタイミングで、同位相かつ同じ周波数の電磁波を発信する確率はほとんどなくなる。よって、他の距離測定装置から発信された電磁波によって測定誤差が著しく増大したり、測定不能となることを防ぐことができる。

- (4) 検出信号関数をフーリエ変換することによって前記周期を求めれば、複数の 測定対象の間に形成された複数の定在波の振幅を同時に測定しても、各定在波 に対してそれぞれ周期を求めることができる。よって、複数の測定対象と検出 手段との間の距離をそれぞれ測定することができる。
- 10 第2発明によれば、以下の(1)~(3)に示す効果が得られる。
- (1) 発信源から出力された出力信号の周波数を変化させれば、送信手段から放出 される電磁波の波長が変化するので、送信手段と測定対象との間の伝搬媒質中 に形成される定在波が変化し、検出手段が設けられた位置における定在波の振 幅が変化する。このため、出力信号の周波数を変化させれば検出手段が出力す る検出信号の値が変化するので、出力信号の周波数情報と検出信号の値から、 15 信号処理器によって検出信号関数を形成することができる。検出手段が設けら れた位置における定在波の振幅は、電磁波の周波数、つまり発信源から出力さ れた出力信号の周波数に対して周期的に変化し、その周期は検出手段から測定 対象までの距離に対して反比例する。したがって、定在波の振幅が極大または 20 極小となる周波数、つまり検出信号関数が極小または極大となる2以上の周波 数を検出し、この2以上の周波数のうち、任意に選択した2つの選択周波数と 、その選択周波数の間に形成される極小または極大となる周波数の数を算出す れば、検出信号関数の周期を求めることができるので、検出手段から測定対象 までの距離を測定することかできる。
- 25 (2) 検出手段から測定対象までの距離は、出力信号の周波数に対する定在波の振幅の変動周期にのみ依存し、送信手段によって電磁波を発信してから測定対象に反射して検出手段に戻るまでの時間の影響を受けないので、測定対象までの距離が数10センチ以下の近距離であっても、精度よく測定できる。
 - (3) 検出信号関数を形成させるときに、出力信号の周波数をランダムに変化させ

た場合、例えば、M系列符号等に従い出力信号の周波数をランダムに変化させれば、距離測定装置同士が、同じタイミングで、同位相かつ同じ周波数の電磁波を発信する確率はほとんどなくなる。よって、他の距離測定装置から発信された電磁波によって測定誤差が著しく増大したり、測定不能となることを防ぐことができる。

第3発明によれば、以下の(4)に示す効果が得られる。

(4) 受信部が出力した検知信号を同期検波して検波信号を形成し、この検波信号の振幅に対応する検出信号を検波部が出力する。すると、検出信号曲線は、定在波の振幅が極小または極大となる周波数近傍では単調増加又は単調減少、しかも、定在波の振幅が極小または極大となる周波数の前後で、検出信号曲線の検出信号の値の符号が変化する曲線となる。したがって、定在波の振幅が極小または極大となる周波数の検出が正確になり、測定誤差を小さくすることができる。

第4発明によれば、以下の(6)~(9)に示す効果が得られる。

- (6) 発光源から発信された光の発光強度変化の周波数を変化させれば、光の発光強度変化の波長が変化するので、定在波形成手段によって形成される定在波が変化し、検出手段が検知する定在波の振幅が変化する。このため、光の発光強度変化の周波数を変化させれば検出手段が出力する検出信号の値が変化するので、光の発光強度変化の周波数情報と検出信号の値から、信号処理器によって後出信号関数を形成させることができる。検出手段が検知する定在波の振幅は、光の発光強度変化の周波数に対して周期的に変化し、その周期は検出手段から測定対象までの距離に対して反比例する。したがって、信号処理器によって検出信号関数の周期が求められるから、その周期より検出手段から測定対象までの距離が算出することができ、検出手段から測定対象までの距離を測定することができる。
 - (7) 検出手段から測定対象までの距離は、光の発光強度変化の周波数に対する定在波の振幅の変動周期にのみ依存し、発光源によって光を発信してから測定対象に反射して検出手段に戻るまでの時間の影響を受けないので、測定対象までの距離が数10センチ以下の近距離であっても、精度よく測定できる。

15

20

25

- (8) 検出信号関数を形成させるときに、光の発光強度変化の周波数をランダムに変化させた場合、例えば、M系列符号等に従い光の発光強度変化の周波数をランダムに変化させれば、距離測定装置同士が、同じタイミングで、同位相かつ光の発光強度変化の周波数が同じである光を発信する確率はほとんどなくなる。よって、他の距離測定装置から発信された光によって測定誤差が著しく増大したり、測定不能となることを防ぐことができる。
- (9) 検出信号関数をフーリエ変換することによって前記周期を求めれば、複数の 測定対象の間に形成された複数の定在波の振幅を同時に測定しても、各定在波 に対してそれぞれ周期を求めることができる。よって、複数の測定対象と検出 手段との間の距離をそれぞれ測定することができる。

第5発明によれば、以下の(6)~(8)に示す効果が得られる。

- (6) 発光源から発信された光の発光強度変化の周波数を変化させれば、光の発光強度変化の波長が変化するので、定在波形成手段によって形成される定在波が変化し、検出手段が検知する定在波の振幅が変化する。このため、光の発光強度変化の周波数を変化させれば検出手段が出力する検出信号の値が変化するので、光の発光強度変化の周波数情報と検出信号の値から、信号処理器によって検出信号関数を形成させることができる。検出手段が検知する定在波の振幅は、光の発光強度変化の周波数に対して周期的に変化し、その周期は検出手段から測定対象までの距離に対して反比例する。したがって、定在波の振幅が極大または極小となる発光強度変化の周波数、つまり検出信号関数が極小または極大となる2以上の光の発光強度変化の周波数を検出し、この2以上の光の発光強度変化の周波数を検出し、この2以上の光の発光強度変化の周波数を検出し、この2以上の光の発光強度変化の周波数を検出し、この2以上の光の発光強度変化の周波数を検出し、この2以上の光の発光強度変化の周波数を検出し、この2以上の光の発光強度変化の周波数を検出し、この2以上の光の発光強度変化の周波数のうち、任意に選択した2つの選択周波数と、その選択周波数の間に形成される極小または極大となる周波数の数を算出すれば、検出信号関数の周期を求めることができるので、検出手段から測定対象までの距離を測定することかできる。
- (7) 検出手段から測定対象までの距離は、光の発光強度変化の周波数に対する 定在波の振幅の変動周期にのみ依存し、発光源によって光を発信してから測定 対象に反射して検出手段に戻るまでの時間の影響を受けないので、測定対象ま での距離が数10センチ以下の近距離であっても、精度よく測定できる。

25

(8) 検出信号関数を形成させるときに、光の発光強度変化の周波数をランダムに変化させた場合、例えば、M系列符号等に従い光の発光強度変化の周波数をランダムに変化させれば、距離測定装置同士が、同じタイミングで、同位相かつ光の発光強度変化の周波数が同じである光を発信する確率はほとんどなくなる。よって、他の距離測定装置から発信された光によって測定誤差が著しく増大したり、測定不能となることを防ぐことができる。

第6発明によれば、以下の(10)に示す効果が得られる。

- (10) 受信部が出力した検知信号を同期検波して検波信号を形成し、この検波信号の振幅に対応する検出信号を検波部が出力する。すると、検出信号曲線は、
- 10 定在波の振幅が極小または極大となる周波数近傍では単調増加又は単調減少、 しかも、定在波の振幅が極小または極大となる周波数の前後で、検出信号曲線 の検出信号の値の符号が変化する曲線となる。したがって、定在波の振幅が極 小または極大となる光の発光強度変化の周波数の検出が正確になり、測定誤差 を小さくすることができる。
- 15 第7発明によれば、以下の(11)に示す効果が得られる。
 - (11) 複数の距離測定装置を同期して作動すれば、同じ時間における測定対象と各距離測定装置の検出手段との間の距離を同時に求めることができる。したがって、各距離測定装置の検出手段同士の相対的な位置が分かっているので、測定対象の空間座標を算出することができ、測定手段と測定対象との相対的な位置関係を2次元または3次元的に把握することができる。

第8発明によれば、以下の(1)~(4)に示す効果が得られる。

(1) 発信源から出力された出力信号の周波数を変化させれば、送信手段から放出される電磁波の波長が変化するので、送信手段と測定対象との間の伝搬媒質中に形成される定在波が変化し、検出手段が設けられた位置における定在波の振幅が変化する。このため、出力信号の周波数を変化させれば検出手段が出力する検出信号の値が変化するので、出力信号の周波数情報と検出信号の値から、信号処理器によって検出信号関数を形成させることができる。検出手段が設けられた位置における定在波の振幅は、電磁波の周波数、つまり発信源から出力された出力信号の周波数に対して周期的に変化し、その周期は検出手段から測

定対象までの距離に対して反比例する。したがって、信号処理器によって検出信号関数の周期が求められるから、その周期より検出手段から測定対象までの距離が算出することができ、検出手段から測定対象までの距離を測定することができる。

- 5 (2) 検出手段から測定対象までの距離は、出力信号の周波数に対する定在波の振幅の変動周期にのみ依存し、送信手段によって電磁波を発信してから測定対象に反射して検出手段に戻るまでの時間の影響を受けないので、測定対象までの距離が数10センチ以下の近距離であっても、精度よく測定できる。
- (3) 検出信号関数を形成させるときに、出力信号の周波数をランダムに変化させた場合、例えば、M系列符号等に従い出力信号の周波数をランダムに変化させれば、距離測定装置同士が、同じタイミングで、同位相かつ同じ周波数の電磁波を発信する確率はほとんどなくなる。よって、他の距離測定装置から発信された電磁波によって測定誤差が著しく増大したり、測定不能となることを防ぐことができる。
- 15 (4) 検出信号関数をフーリエ変換することによって前記周期を求めれば、複数の測定対象の間に形成された複数の定在波の振幅を同時に測定しても、各定在波に対してそれぞれ周期を求めることができる。よって、複数の測定対象と検出手段との間の距離をそれぞれ測定することができる。

請求の範囲

- 1 測定対象までの距離を測定するための測定装置であって、該測定装置が、
- 5 出力信号の周波数が可変である発信源と、該発信源に接続され、該発信源から 出力された出力信号の周波数と同一の周波定在波の振幅に対応する検出信号を 出力する検出手段と、該検出手段が発信した検出信号および前記発信源から発 信された出力信号の周波数情報が入力され、前記出力信号の周波数に対する数 を有する電磁波を、前記測定対象との間に存在する伝搬媒質に放出する送信手 段と、該送信手段と前記測定対象との間に設けられ、該送信手段と前記測定対 象との間において、前記伝搬媒質中に形成される定在波の振幅を検知し、検知 した前記検出信号の値を示す検出信号関数を形成し、その周期から前記検出手 段と前記測定対象との間の距離を算出する信号処理器とからなることを特徴と する距離測定装置。
- 2 測定対象までの距離を測定するための測定装置であって、該測定装置が、 15 出力信号の周波数が可変である発信源と、該発信源に接続され、該発信源から 出力された出力信号の周波数と同一の周波数を有する電磁波を、前記測定対象 との間に存在する伝搬媒質に放出する送信手段と、該送信手段と前記測定対象 との間に設けられ、該送信手段と前記測定対象との間において、前記伝搬媒質 20 中に形成される定在波の振幅を検知し、検知した定在波の振幅に対応する検出 信号を出力する検出手段と、該検出手段が発信した検出信号および前記発信源 から発信された出力信号の周波数情報が入力され、前記出力信号の周波数に対 する前記検出信号の値を示す検出信号関数を形成し、該検出信号関数が極大ま たは極小となる少なくとも2以上の出力信号の周波数を検出し、該2以上の出 力信号の周波数のうち2つの選択周波数と、該2つの選択周波数の間における 25 極大または極小となる出力信号の周波数の数とから前記検出手段と前記測定対 象との間の距離を算出する信号処理器とからなることを特徴とする距離測定装 置。
 - 3 前記発信源から出力される出力信号を周波数変調させるための変調器が設けら

れており、前記検出手段が、前記定在波の振幅を検出し、その振幅に対応した振幅 を有する検知信号を出力する受信部と、前記変調器から変調信号が入力され、該変 調信号によって前記検知信号を同期検波して検波信号を形成し、該検波信号の振幅 に対応する検出信号を出力する検波部とを備えたことを特徴とする請求項2記載の 距離測定装置。

- 4 測定対象までの距離を測定するための測定装置であって、該測定装置が、 周期的に発光強度が変化する光を発信し、その周波数が可変である発光源と、 該発光源から発信された光を2つに分光し、分光された一方の光を前記測定対 象との間に存在する伝搬媒質に放出する分光手段と、前記測定対象で反射した 一方の光と、分光された他方の光を干渉させて定在波を形成する定在波形成手 10 段と、該定在波形成手段によって形成された定在波の振幅を検知し、検知した 定在波の振幅に対応する検出信号を出力する検出手段と、該検出手段が発信し た検出信号および前記発光源から発信された光の発光強度変化の周波数情報が 入力され、該光の発光強度変化の周波数に対する検出信号の値を示す検出信号 関数を形成し、その周期から前記検出手段と前記測定対象との間の距離を算出 する信号処理器とからなることを特徴とする距離測定装置。
- 5 測定対象までの距離を測定するための測定装置であって、該測定装置が、 周期的に発光強度が変化する光を発信し、その周波数が可変である発光源と、 該発光源から発信された光を2つに分光し、分光された一方の光を前記測定対 象との間に存在する伝搬媒質に放出する分光手段と、前記測定対象で反射した 一方の光と、分光された他方の光を干渉させて定在波を形成する定在波形成手 段と、該定在波形成手段によって形成された定在波の振幅を検知し、検知した 定在波の振幅に対応する検出信号を出力する検出手段と、該検出手段が発信し た検出信号および前記発光源から発信された光の発光強度変化の周波数情報が 入力され、該光の発光強度変化の周波数に対する検出信号の値を示す検出信号 25 関数を形成し、該検出信号関数が極大または極小となる少なくとも2以上の発 光強度変化の周波数を検出し、該2以上の発光強度変化の周波数のうち2つの 選択周波数と、該2つの選択周波数の間における極大または極小となる出力信 号の周波数の数とから前記検出手段と前記測定対象との間の距離を算出する信

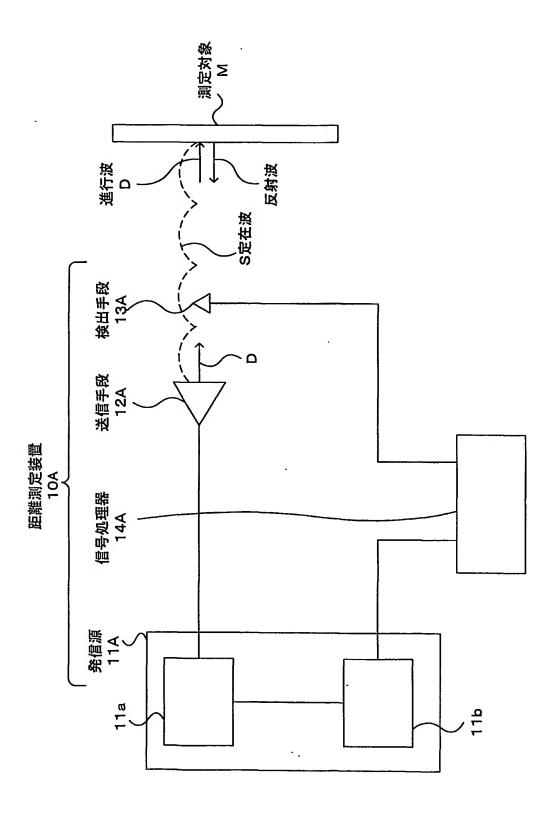
号処理器とからなることを特徴とする距離測定装置。

6 前記発光源が発信する光の発光強度変化を周波数変調させるための変調器が設けられており、前記検出手段が、前記定在波の振幅を検出し、その振幅に対応した振幅を有する検知信号を出力する受信部と、前記変調器から変調信号が入力され、該変調信号によって前記検知信号を同期検波して検波信号を形成し、該検波信号の振幅に対応する検出信号を出力する検波部とを備えたことを特徴とする請求項5記載の距離測定装置。

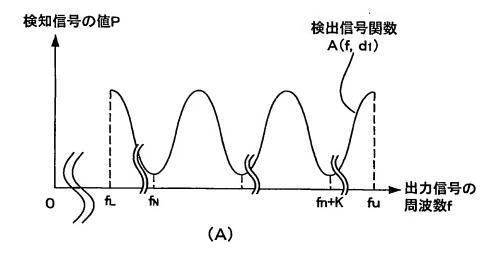
7 測定対象の空間座標を検出することができる測定設備であって、該測定設備が、複数の請求項1、2、3、4、5または6記載の距離測定装置と、該複数の距離測定装置を、同期して作動させる制御装置とからなり、各距離測定装置の信号処理器が算出した検出手段と前記測定対象との間の距離が入力され、入力された各測定装置における検出手段と前記測定対象との間の距離と、各距離測定装置の検出手段同士の相対的な位置とから測定対象の空間座標を算出する演算装置とからなることを特徴とする距離測定設備。

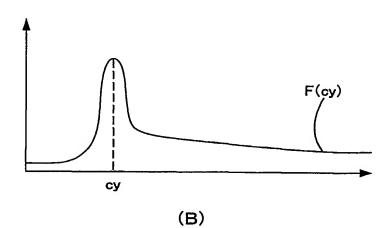
15 8 測定対象までの距離を測定するための測定方法であって、送信手段によって、送信手段と測定対象の間に存在する伝搬媒質に電磁波を放出して、前記送信手段と測定対象との間において、伝搬媒質中に定在波を形成させ、前記送信手段と前記測定対象の間における一定の位置において、検出手段によって、前記定在波の振幅を検出し、前記送信手段が放出する電磁波の周波数を変化させて、該周波数に対する前記定在波の振幅を示す振幅曲線を形成し、該振幅曲線の周期から、前記検出手段と前記測定対象との間の距離を算出することを特徴とする距離測定方法。

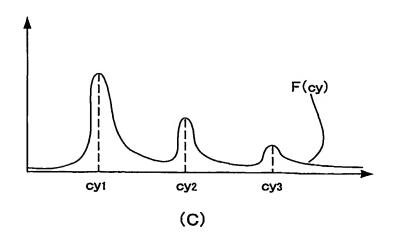
1/12 FIG.1



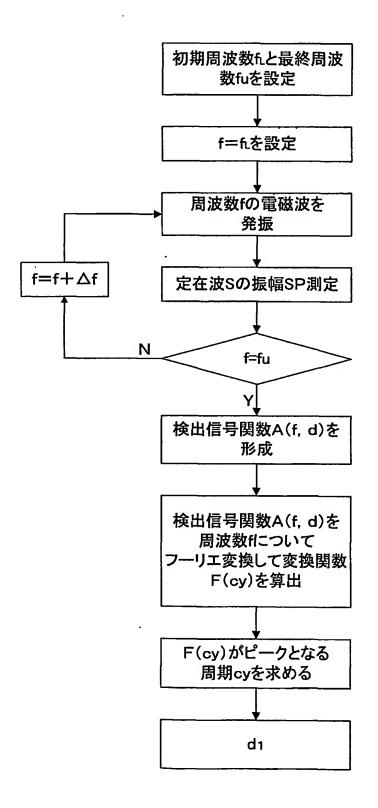
2/12 FIG.2



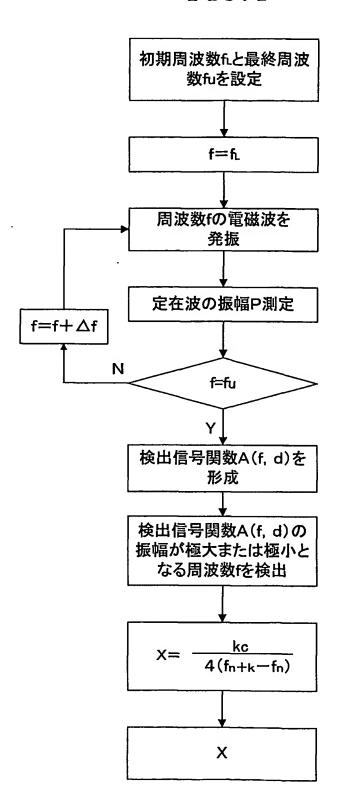




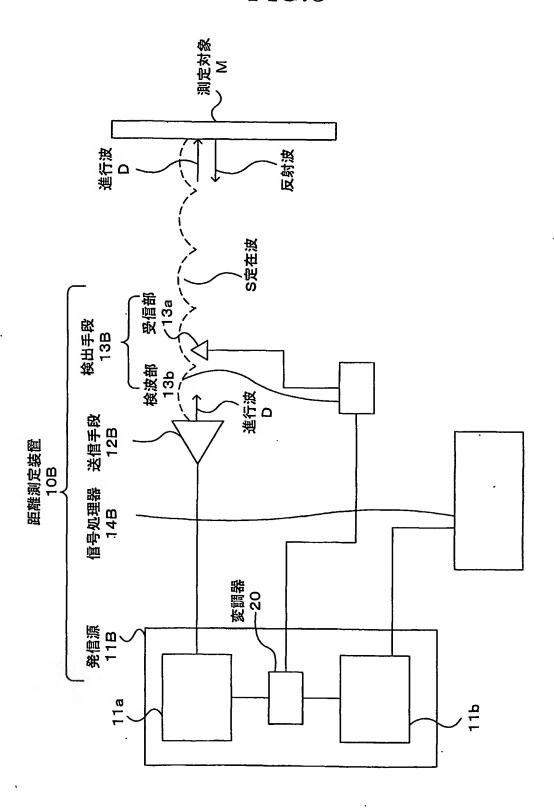
3/12 FIG.3



4/12 FIG.4

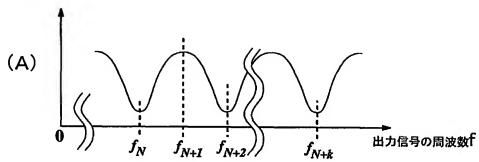


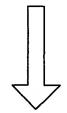
5/12 FIG.5

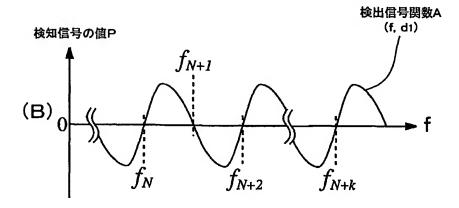


6/12 FIG.6

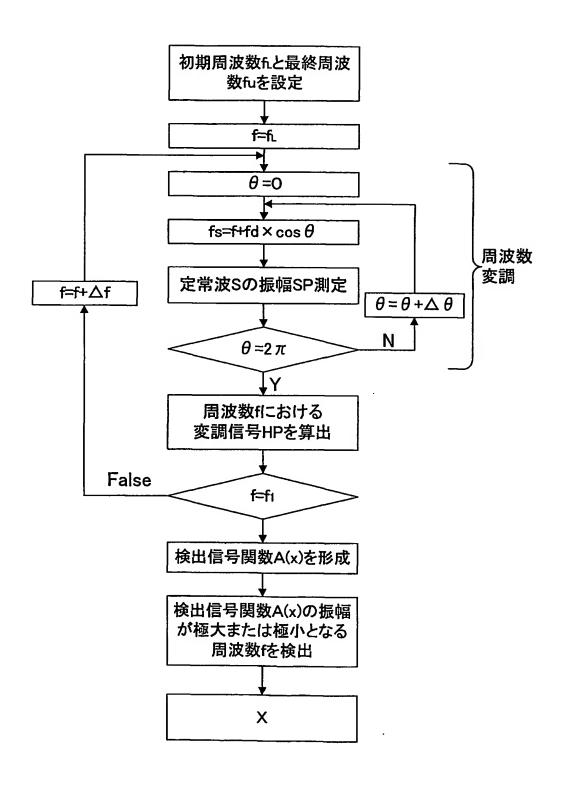
定常波Sの振幅SP



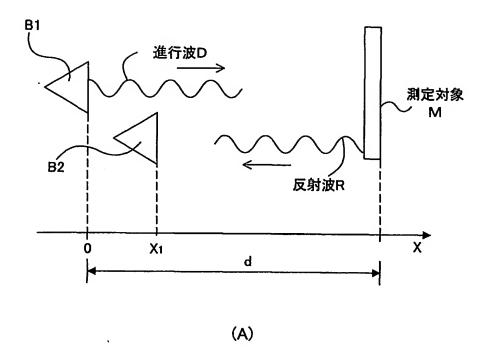


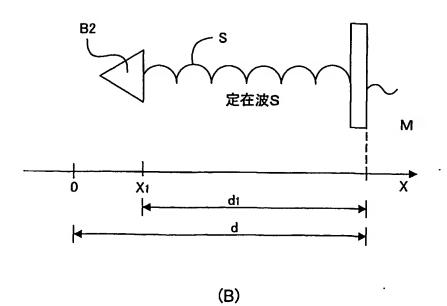


7/12 FIG.7

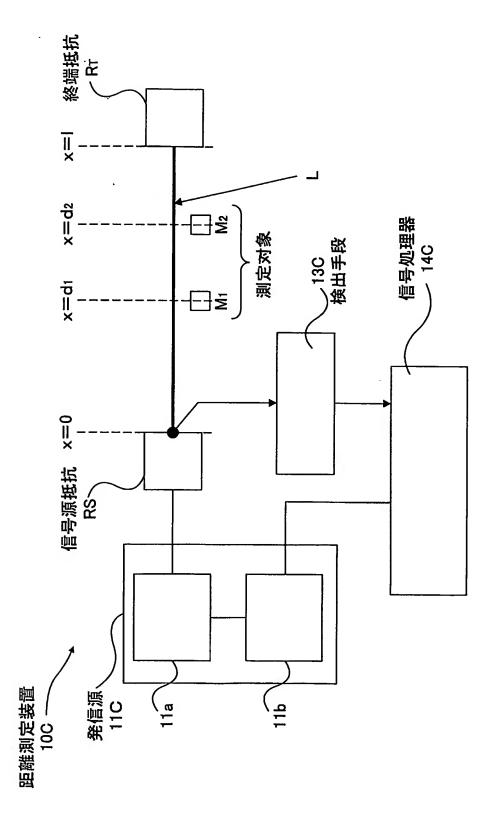


8/12 FIG.8

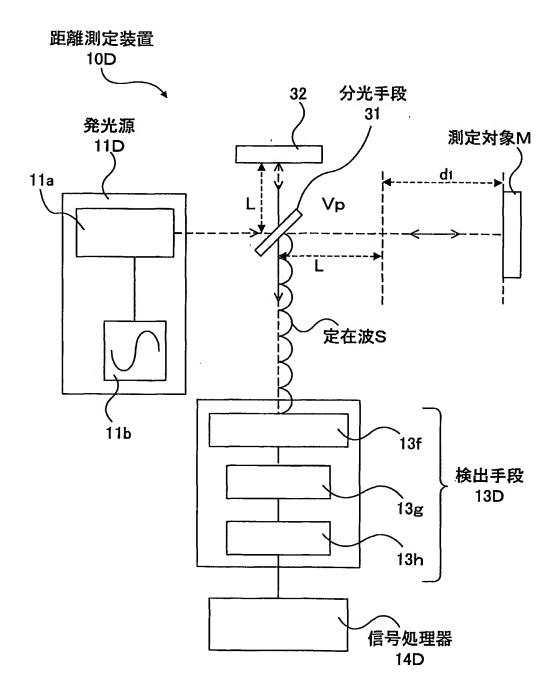




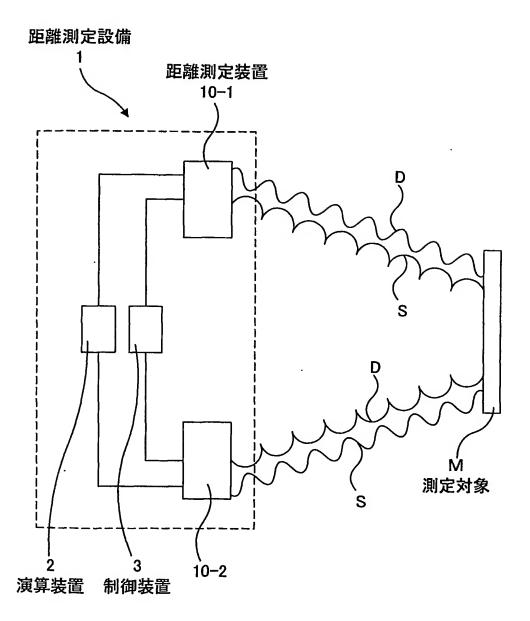
9/12 FIG.9



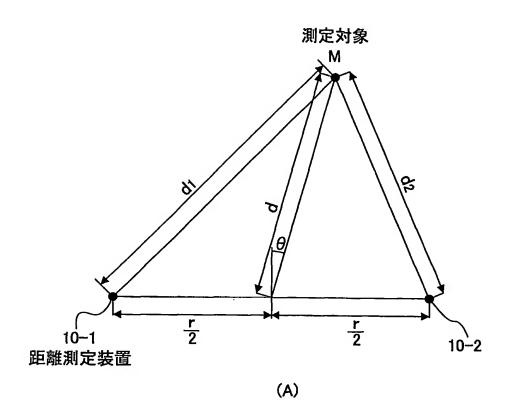
10/12 FIG.10



11/12 FIG.11



12/12 FIG.12



(1)
$$d = \sqrt{\frac{d1^2}{2} + \frac{d2^2}{2} - r^2}$$

$$\sin \theta = \frac{d2^2 - d1^2}{4rd}$$

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP02/01825

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ G01S13/32, G01B15/00, G01S17/32, G01C3/06, G01B11/00						
	to International Patent Classification (IPC) or to both no	ational classification and IPC				
	S SEARCHED		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Int.	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ G01S13/32, G01B15/00, G01S17/32, G01C3/06, G01B11/00					
	tion searched other than minimum documentation to the					
Koka	Jitsuyo Shinan Koho 1922—1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994—2002 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971—2002 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996—2002					
Electronic u	data base consulted during the international search (nam	ie of data base and, where practicable, sear	rch terms used)			
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.			
	JP, 59-142485, A (Yamatake-H	ioneywell Co., Ltd.),				
· ·	15 August, 1984 (15.08.84),		1 0 0			
X Y	Full text; all drawings Full text; all drawings		1,2,8 3,4,5,6,7			
1	(Family: none)	I	3,4,3,0,1			
	(ramity. mone,					
Y	JP, 6-160082, A (Matsushita	Electric Works, Ltd.),	3,6			
	07 June, 1994 (07.06.94),		•			
	Page 2, left column, lines 46	5 to 48				
	(Family: none)					
τ,	TO F COCATO & /AMB Ontical					
Y	JP, 5-203412, A (ATR Optical Communications),	and Radio	4,5,6			
	10 August, 1993 (10.08.93),					
	Fig. 2	1				
1	(Family: none)	1				
1	* ······					
Y	JP, 38-1257, B1 (Anritsu Den		7			
	20 February, 1963 (20.02.63),		•			
	Full text; all drawings	·				
	(Family: none)					
× Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
	categories of cited documents:	"I" later document published after the inte				
conside	ent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	priority date and not in conflict with th understand the principle or theory under				
"E" earlier	document but published on or after the international filing	"X" document of particular relevance; the c	claimed invention cannot be			
"L" docume	ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is	 considered novel or cannot be considered step when the document is taken alone 				
cited to	establish the publication date of another citation or other	"Y" document of particular relevance; the c	claimed invention cannot be			
	reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	considered to involve an inventive step combined with one or more other such				
means		combination being obvious to a person	skilled in the art			
"P" document published prior to the international filing date but later "&" document member of the same patent family than the priority date claimed						
Date of the a	actual completion of the international search	Date of mailing of the international search	-			
26 March, 2002 (26.03.02) 02 April, 2002 (02.04.02)						
Name and mailing address of the ISA/		Authorized officer				
Japanese Patent Office						
Facsimile No.		Telephone No.				

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1998)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP02/01825

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
P,X	Tetsushi UEBO, Takashi KITAGAWA, Tadamitsu IRIYA, "Teizaiha o Mochii Sul0cm kara Sokutei Kano na Kobunkaino Radar", The Institute of Electronics, Information and Communication engineers Gijutsu Kenkyu Hokoku, Vol.100, No.693 (The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers), 08 March, 2001 (08.03.01), Pages 161 to 166	1,2,3				
A	JP, 5-281341, A (Isao IIDA), 29 October, 1993 (29.10.93), Full text; all drawings (Family: none)	1-8				
A	JP, 58-198781, A (Tasuku TAKAGI), 18 November, 1983 (18.11.83), Full text; all drawings (Family: none)	1-8				

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1998)

A. 発明の	関する分野の分類(国際特許分類(IPC))			
	Int. Cl' G01S13/3	2, G01B15/00, G01S17	/32	
		, G01B11/00	, 02	
D ######	- 1 /\ E72	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
B. 調査を行った	Tった分野 最小限資料(国際特許分類(IPC))		·	
神中でですりっとに	KUNKERAT (EDATORIO)			
		2, G01B15/00, G01S17	/32	
	G01C3/06	, G01B11/00		
最小限资料以外	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
日本	国実用新案公報 1922-19	·		
	国公開実用新案公報 1971-20	•		
	:国登録実用新案公報 1994-20 :国実用新案登録公報 1996-20			
国際調査で使用	用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)		
	•			
		•		
C. 関連する	ろと認められる文献			
引用文献の	J C 100 5100 5100		関連する	
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	ときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号	
	JP 59-142485 A (山道	武/ネウエル株式会社)		
	1984.08.15			
X	全文,全図		1, 2, 8	
Y	全文,全図		3, 4, 5, 6, 7	
	(ファミリーなし)			
Y	ID 6 160000 A (#\\T6	ラナザ ート ヘル)	1	
Y	JP 6-160082 A (松下作 1994.06.07	毛工体入会在)	3, 6	
	第2頁左欄第46行~第48行()	ファミリーかし	1	
	为2只在侧别4011°别4011()		ļ	
····	<u> </u>			
X C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。	
* 引用文献の	のカテゴリー	の日の後に公表された文献		
「A」特に関連	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表	された文献であって	
もの		出願と矛盾するものではなく、	発明の原理又は理論	
	頭日前の出願または特許であるが、国際出願日 公表されたもの	の理解のために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、	当該文献の2 788四	
「L」優先権	ョ 阪 ス 欧 ツ へ て 元 分 えられるもの			
日若し	くは他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、	当該文献と他の1以	
文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自 「O」口頭による閉示、使用、展示等に官及する文献 よって進歩性がないと考えられる				
	よる聞示、使用、展示寺に自及する文献 預日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	よって進歩性がないと考えられ「&」同一パテントファミリー文献	5 600	
国際調査を完了	了した日 26.03.02	国際調査報告の発送日 0 2.04.	(12	
		52.04.	<u> </u>	
国際調査機関の名称及びあて先		特許庁審査官(権限のある職員)	25 9705	
日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915		神谷健一(江		
	野使番号100ー8913 節千代田区館が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	が 内線 3256	
/5///	The state of the s	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		

C (続き).	. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*		関連する 請求の範囲の番号		
Y	JP 5-203412 A (株式会社エイ・ティ・アール光電波通信研究所) 1993.08.10,第2図 (ファミリーなし)	4, 5, 6		
Y	JP 38-1257 B1 (安立電波工業株式会社) 1963.02.20,全文,全図 (ファミリーなし)	. 7		
P, X	上保 徹志,北川 喬,入谷 忠光 '定在波を用い数10cmから測定可能な高分解能レーダ' 電子情報通信学会技術研究報告,Vol.100 No.693 (社団法人電子情報通信学会) 2001.03.08,p161-166	1, 2, 3		
A	JP 5-281341 A (飯田 功) 1993.10.29,全文,全図 (ファミリーなし)	1-8		
A	JP 58-198781 A (高木相) 1983.11.18,全文,全図 (ファミリーなし)	1-8		